



◆優れた面内温度分布を実現

発熱体(ヒーター)は熱解析により、改良、改善を繰り返し行い
高精度化を追求しております

◆量産に最適

より高い再現性を追求した結果、発熱体はパターン化を行い
個体間の精度のばらつきを最小に抑えました

◆オープンユニットで製作対応

ウェーハ上、ガラス基板上の温度分布向上の為
オープンユニットで製作対応いたします

◆Application

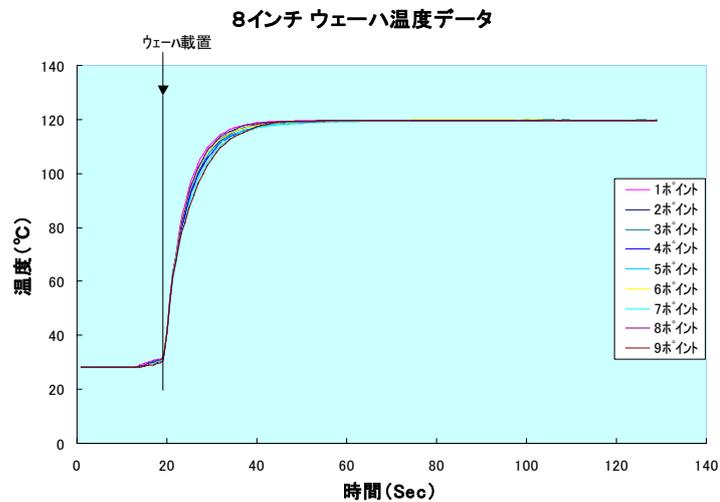
半導体、FPD製造装置の各熱処理プロセスの、次のような工程に採用実績があります。

PEB (化学増幅型レジストベーク)	エッチャー用プレート
レジストベークプレート	アッシング用プレート
HMDSベークプレート	スパッタ用プレート
脱水ベークプレート	ハンドラ用プレート
CVD用プレート	

ホットプレート

◆半導体用・FPD用◆

◆プロフィールデータ



◆ホットプレート構造図

